Abstract

基板研磨装置の基板保持装置が有する弾性膜の第１面に吸着された基板を離脱させる方法であって、前記基板保持装置が有するトップリング本体と前記弾性膜の第２面との間には、同心状の複数の圧力室が形成されており、前記複数の圧力室のうち２以上の圧力室に定量気体を供給して前記弾性膜を加圧する第１工程と、前記複数の圧力室を外側の圧力室から順に減圧する第２工程と、を含む方法が提供される。

図 13